

〔国際会議発表〕

発表研究者	東京農工大学 大学院工学府 後期博士課程 山口 眞和	2232111
参加会議	The 37 th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems (IEEE MEMS 2024)	
開催場所	Austin, Texas, USA	
出張期間	2024 年 1 月 20 日～2024 年 1 月 27 日（8 日間）	
発表論文	Improvement of transmittance and diffraction efficiency of metasurface holograms using silicon nitride	

概要：

当国際会議（The 37th IEEE International Conference on Micro Electro Mechanical Systems: IEEE MEMS 2024）は MEMS 分野でトップレベルに位置づけられている国際会議であり、25% 程度という低い採択率のもと選ばれた、MEMS/NEMS 分野における最先端の研究が多数発表される。本会議に参加し発表を行うことは、単に最新の研究に関する知見が得られるだけでなく、世界中の研究者との交流を通じて自身の研究の位置づけや意義を把握するという意味でも、非常に価値のあることである。

報告者は当国際会議において、「Improvement of transmittance and diffraction efficiency of metasurface holograms using silicon nitride」という題目で、MEMS を光学へと応用した立体映像表示デバイスについてのポスター発表を行った。発表には様々なバックグラウンドを持つ研究者が訪れ、報告者は多角的な視点からの質問を投げかけられた。特に印象に残ったのは、研究を産業へと活かしていく方法に関する質問であり、自分の研究のさらなる展望を見つめなおし、アントレプレナーシップなどについて考える機会となった。また、当国際会議では、報告者と同じく MEMS を光の分野へと応用したデバイスについて聴講し、自身の研究に取り込む手法を検討した。さらに、聴講した研究について会議参加後に研究室で発表を行い、得られた知見を周囲にも共有した。これにより、会議に参加して得られた成果を何倍にも増幅させることができた。国際会議期間中には懇親会も開催されており、そこでは国外の研究者と積極的に交流を行った。懇親会には報告者と同じく博士課程に所属している学生も多く、将来の進路や研究時のモチベーション維持など、今後研究を続けていくうえで非常に重要な内容を話すことができた。

当該国際会議に参加することで、報告者は最先端の研究に関する知見の獲得や将来の展望の考案など、非常に多くの成果を得ることができた。これらの成果を、今後の研究に活かしていきたい。